

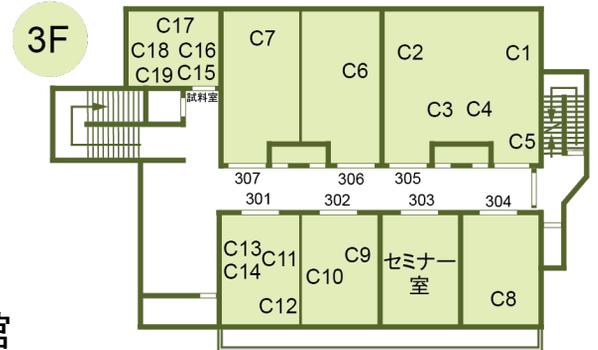
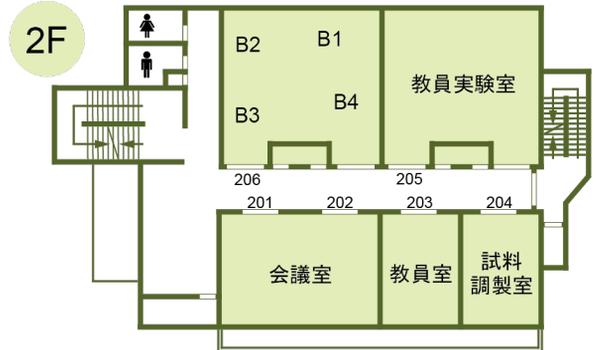
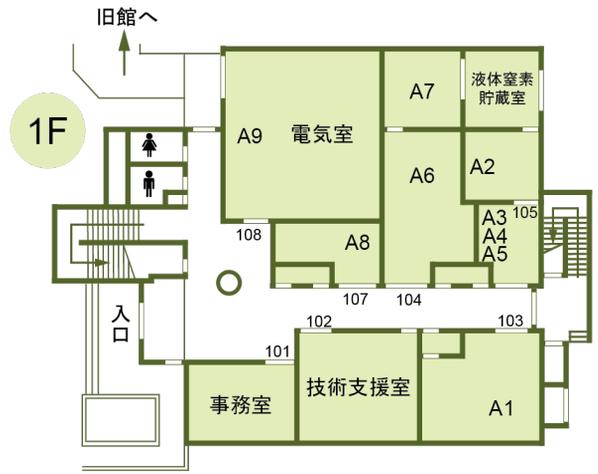
# 設置機器一覧

## 新館

- A1 核磁気共鳴装置 (NMR)
- A2 ホール測定装置
- A3 DLTS測定装置
- A4 強誘電体特性測定装置
- A5 LCRメータ
- A6 電子スピン共鳴装置 (ESR) FA-200
- A7 電子スピン共鳴装置 (ESR) FA-300
- A8 ハンドヘルド蛍光X線分析装置
- A9 Heリークディテクター

- B1 電界放射型電子プローブマイクロアナライザー (FE-EPMA)
- B2 電界放射型走査電子顕微鏡 (FE-SEM)
- B3 クロスセクションポリリッシャ (CP)
- B4 真空蒸着装置

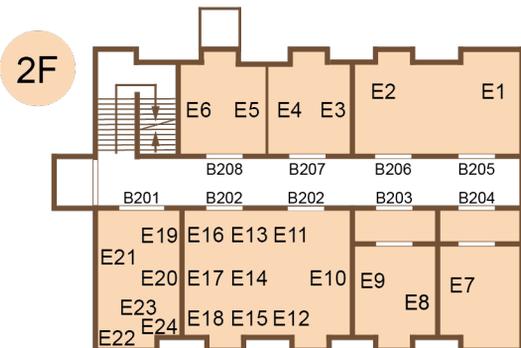
- C1 オージェ電子分光装置 (AES)
- C2 X線光電子分光装置 (XPS)
- C3 分光エリブソメータ (JAW)
- C4 分光エリブソメータ (Sentec)
- C5 触針式表面形状測定装置
- C6 電界放射型走査電子顕微鏡 (FE-SEM)
- C7 蛍光X線分析装置 (XRF)
- C8 ICP発光分光分析装置 (ICP-OES)
- C9 顕微紫外可視近赤外分光光度計 (UV-Vis-NIR)
- C10 フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR)
- C11 多目的画像解析装置
- C12 PCR装置
- C13 熱重量示差熱分析装置 (TG-DTA)
- C14 示差走査熱量分析装置 (DSC)
- C15 試料包埋機
- C16 電解研磨装置
- C17 機械研磨装置
- C18 ソフトプラズマエッチング装置
- C19 イオンエッチング装置



## 旧館



- D1 三次元座標測定器
- D2 三次元粗さ測定装置
- D3 円柱形状測定器
- D4 ワンショット3D形状測定器 (ものづくり所有)
- D5 多目的X線回折装置
- D6 小型万能試験機
- D7 歪測定器
- D8 電界放射型透過電子顕微鏡 (FE-TEM)
- D9 集束イオンビーム加工装置 (FIB)
- D10 透過電子顕微鏡 (TEM)
- D11 走査透過電子顕微鏡 (STEM)
- D12 プラズマクリーナ



- E1 液体クロマトグラフ質量分析装置
- E2 ガスクロマトグラフ質量分析装置
- E3 密着強度測定機
- E4 光学顕微鏡
- E5 走査プローブ顕微鏡 (SPM)
- E6 ナノインデンタ
- E7 レーザラマン分光光度計
- E8 粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置
- E9 有機微量元素分析装置
- E10 オスmiumコータ
- E11 イオンスノッパ装置
- E12 カラーレーザー顕微鏡
- E13 マニピュレータ
- E14 試料トリミング装置
- E15 ウルトラクライオミクローム
- E16 真空蒸着装置
- E17 低角イオンミリング
- E18 試料研磨システム
- E19 ウルトラミクローム
- E20 ミクローム
- E21 真空蒸着装置 (DP)
- E22 デンプルグラインダー
- E23 硬質材料用研磨装置
- E24 マイクロソー